

國立成功大學 基礎研究核心設施
多功能 X 光薄膜繞射儀使用申請實驗記錄表

使用日期：____年__月__日

使用者		指導教授 / 單位	
預約序號	BSXRD001900_____	使用者電話	
樣品組成		使用者 E-mail	
選用分析	<input type="checkbox"/> 低掠角薄膜繞射	<input type="checkbox"/> 殘留應力分析	<input type="checkbox"/> 極圖分析
方式	<input type="checkbox"/> Rcking Curve	<input type="checkbox"/> Reflectivity	<input type="checkbox"/> Microarea / Diffraction
<p>1. 殘留應力分析:</p> <p>高角度繞射位置 2Theta____hkl____,</p> <p>格子常數:a____ b____ c____</p> <p>Alpha:____ Beta:____ Garma:____</p> <p>Young's modul:____MPa, Poission ratio:____</p>		<p>4. Rocking Curve:2Theta from ____to____</p> <p>請描繪磊晶層數，組成成分，大約厚度(nm)</p>	
<p>2. 極圖分析:繞射位置 2Theta____</p> <p>3. 低掠角薄膜繞射:2Theta from____to____</p> <p>入射角度:____</p> <p>掃描方式:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Step scan (____)degree/step (____)sec/step</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Continuous scan 掃描速度:(____)/min</p>		<p>5. Reflectivity:</p> <p>請描繪詳細結構圖，組成元素，組成密度(g/cm³)及鍍層大約厚度(nm):</p>	
<p>實驗檔案名稱:</p> <p>備註:</p> <p>交件日期: 年 月 日 寄出</p>			
<p>儀器代碼: XRD001900 Multipurpose High intensity X-Ray Thin-Film Micro Area Diffractometer (XRD001900) belonging to the Core Facility Center of National Cheng Kung University</p>			